

**(株)リガク製 X線回折装置 SLX2000**

製造元	(株)リガク
仕様	X線回折装置. 60 kV, 300 mA. $2\theta$ 分解能=0.0002 度, $\omega$ 分解能=0.0001 度
保有部署	電子工学専攻 川上研究室
設置場所	桂・A1 棟・B1 階 005 室)
利用期間・時間、 利用料金	本設備の共同利用規程を参照 <a href="https://www.t.kyoto-u.ac.jp/ja/research/yui/naiki/20210311-denshi">https://www.t.kyoto-u.ac.jp/ja/research/yui/naiki/20210311-denshi</a>
注意事項等	利用講習を受講のうえ、利用者自身で測定
連絡先	電子工学専攻川上研究室 075-383-2309 xrd-yui@optomater.kuee.kyoto-u.ac.jp (利用申請前に、利用の概略(形式任意)をこちら宛にお知らせください。)
キーワード	結晶構造評価, 面間隔評価, 配向性評価
機器コード	0000107001
自由記入欄	通常の $2\theta/\omega$ あるいは $\omega$ スキャンに加え, 逆格子マッピング, 極点測定, 反射測定が可能. $2\theta$ および $\omega$ の分解能が高いため, 精密測定に向けた装置.

